

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

09.06.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 6月13日

出 願 番 号
Application Number:

特願2003-170051

[ST. 10/C]:

[JP2003-170051]

出 願 人 Applicant(s):

独立行政法人理化学研究所

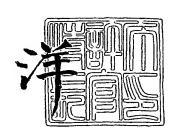
REC'D 1 0 SEP 2004

PRIORITY DOCUMENT SUBMITTED OR TRANSMITTED IN

COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 8月26日

1)1



【書類名】

特許願

【整理番号】

A35048H

【提出日】

平成15年 6月13日

【あて先】

特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

田代 英夫

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

近藤 恭光

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

橘内 徳司

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

畠山 哲

【特許出願人】

【識別番号】

000006792

【氏名又は名称】

理化学研究所

【代理人】

【識別番号】

110000109

【氏名又は名称】 特許業務法人特許事務所サイクス

【代表者】

今村 正純

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 170347

【納付金額】

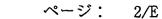
21,000円

【その他】

国等の委託研究(文部科学省 科学技術振興調整費ゲノ

ムフロンティア開拓研究推進制度「次世代DNAマイク

ロアレイシステムの開発」)の成果に係る特許出願(産





# 業再生法第30条の適用を受けるもの)

# 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0205404

【プルーフの要否】 要



#### 【書類名】明細書

【発明の名称】生体分子マイクロアレイ用基板、生体分子マイクロアレイ、相互作用促進用装置および方法、ならびに、相互作用の検出方法

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】基板表面に、生体分子固定化用スポットを1つ以上有する生体分子 マイクロアレイ用基板であって、

前記生体分子固定化用スポットが、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有し(以下、「突出スポット部」という)、かつ

少なくとも、前記突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およびスポット用平面が、導電性物質からなることを特徴とする基板。

【請求項2】前記突出スポット部周辺の基板表面が、略V字型底面を形成する請求項1に記載の基板。

【請求項3】基板表面に、生体分子固定化用スポットを1つ以上有する生体分子 マイクロアレイ用基板であって、

前記生体分子固定化用スポットが、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット 用平面を有し(以下、「突出スポット部」という)、

隣り合う突出スポット部は、突出スポット部側面によって隣接しており、かつ

少なくとも、前記突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなることを特徴とする基板。

【請求項4】前記導電性物質が、金、ニッケル、白金、銀、チタン、アルミニウム、ステンレス、銅、導電性酸化物、または導電性プラスチックである請求項1~3のいずれか1項に記載の基板。

【請求項5】前記基板は、基板全体が導電性物質からなるか、または、基板表面 に導電性物質被覆層を有する請求項1~4のいずれか1項に記載の基板。

【請求項6】前記導電性被覆層を有する基板が、ガラス、金属、シリコン、またはプラスチックからなる請求項5に記載の基板。

【請求項7】前記突出スポット部の高さが、 $10\sim500\mu$ mである請求項 $1\sim6$ のいずれか1項に記載の基板。



【請求項8】前記突出スポット部頂上のスポット用平面と前記突出スポット部側面とのなす角が、90度以上である請求項1~7のいずれか1項に記載の基板。

【請求項9】前記スポット用平面が粗面化されている請求項1~8のいずれか1項に記載の基板。

【請求項10】請求項1~9のいずれか1項に記載の基板および生体分子を含み、生体分子は、前記基板上の少なくともスポット用平面に固定化されていることを特徴とする生体分子マイクロアレイ。

【請求項11】前記生体分子は、DNA、RNA、PNA、蛋白、ポリペプチド、糖化合物、脂質、天然低分子、および合成低分子からなる群から選ばれる少なくとも一種である請求項10に記載の生体分子マイクロアレイ。

【請求項12】基板上に1つ以上の生体分子固定化スポットを有する生体分子マイクロアレイ、

前記マイクロアレイの生体分子固定化スポットを有する面に対向するように設けられた電極、および

前記マイクロアレイと前記電極との間に電界を印加するための電源 を有する、生体分子の相互作用促進用装置であって、

前記生体分子マイクロアレイを構成する基板は、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有する生体分子固定化用スポット(以下、「突出スポット部」という)を有し、

少なくとも前記突出スポット部は導電性物質表面を有し、

前記スポット用平面の導電性物質表面に生体分子が固定化され、前記生体分子 固定化スポットが形成されており、かつ

前記基板は、前記基板上の突出スポット部以外の表面に、前記突出スポット部の導電性物質表面と通電可能な端子を有することを特徴とする、生体分子の相互作用促進用装置。

【請求項13】前記基板上の突出スポット部以外の表面は、導電性物質被覆層を有し、前記端子は、前記導電性物質被覆層に含まれるか、または、前記導電性物質被覆層と通電可能であり、かつこの導電性物質被覆層と突出スポット部の導電性物質表面とは、一体の導電性物質被覆層として設けられている請求項12に記



載の装置。

【請求項14】前記生体分子マイクロアレイが、請求項10または11に記載の 生体分子マイクロアレイである請求項12または13に記載の装置。

【請求項15】前記スポット用平面と電極との距離が、 $1\sim500\mu$  mである請求項 $12\sim14$  のいずれか1項に記載の装置。

【請求項16】前記マイクロアレイと電極との間に、非導電性スペーサーを有する請求項12~15のいずれか1項に記載の装置。

【請求項17】前記マイクロアレイの生体分子スポットを有する面に対向するように設けられた電極が、透明電極である請求項12~16のいずれか1項に記載の装置。

【請求項18】温度制御手段を更に有する請求項12~17のいずか1項に記載の装置。

【請求項19】請求項12~18のいずれか1項に記載の装置を用いる、生体分子の相互作用促進方法であって、

前記マイクロアレイと電極との間に、ターゲット生体分子を含む溶液を配置し、かつ、

前記マイクロアレイと電極との間に電界を印加することを特徴とする、生体分子の相互作用促進方法。

【請求項20】前記マイクロアレイと電極との間に印加される電界が、0.00  $1\sim10\,\mathrm{MV/m}$ である請求項19に記載の方法。

【請求項21】前記ターゲット生体分子が、蛍光標識されている請求項19または20に記載の方法。

【請求項22】ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれているか、または、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれていた請求項10または11に記載のマイクロアレイの各生体分子固定化スポット上の生体分子と前記ターゲット生体分子との間の相互作用を、共焦点型検出器によって検出することを特徴とする生体分子の相互作用の検出方法。

【請求項23】前記マイクロアレイは、請求項19~21のいずれか1項に記載の方法を用いて、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれているか



、または、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれていた、請求項 22に記載の方法。

【請求項24】前記固定化スポット上の生体分子および/または前記ターゲット 生体分子が蛍光標識されている請求項22または23に記載の方法。

【請求項25】前記共焦点型検出器によって、マイクロアレイ表面の突出スポット部とそれ以外の部分の高さおよび/または形状の差による反射光強度の相違から、マイクロアレイ上の前記突出スポット部を反射像として検出する請求項22~24のいずれか1項に記載の方法。

【請求項26】前記反射像として検出された突出スポット部からの蛍光を検出することにより、生体分子の相互作用を検出する請求項25に記載の検出方法。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、生体分子固定の定量化及びデジタル解析が可能な生体分子マイクロアレイ用基板、前記基板に生体分子が固定されていることを特徴とする生体分子マイクロアレイ、前記マイクロアレイを用いる、生体分子の相互作用促進用装置および相互作用促進方法、ならびに、生体分子の相互作用の検出方法に関する。

[0002]

#### 【従来の技術】

遺伝子診断や病原菌の特定、あるいは一塩基多型の検出等、ある種の核酸(ターゲット核酸)を検出する目的で、プローブ核酸とターゲット核酸とのハイブリダイゼーションが利用されている。近年、多数のプローブ核酸を基板に固定したDNAチップやDNAマイクロアレイが実用されるようになり、ターゲット核酸の検出に使用されている。

[0003]

DNAチップやDNAマイクロアレイの作製においては、基板にDNAを多数スポットとして整列させて固定化する必要がある。DNAの固定化には、例えば、チオールを一本鎖DNAに接合させ、チオール化した一本鎖DNAを、例えば、金属基板に固定化する方法が取られている。そして、固定化されたDNAに被



検体であるターゲットDNAを作用させ、ハイブリダイゼーションの有無を検出する。ハイブリダイゼーションの有無は、例えば、蛍光法を用いて、ターゲットDNAとハイブリダイズした固定化DNAのスポットの蛍光を測定することによって検出することができる。

## [0004]

スポッティング型のDNAマイクロアレイは、プローブDNAを含む液滴を基板上に 載せて乾かすことによって作製される(非特許文献 1 参照)。そのため、安価に 作製できるという利点がある反面、基板上に固定されるDNAの均一さが保証され ない、すなわち、DNA検出スポット部の寸法や形状がばらつくという欠点がある 。これらの欠点は、例えばDNA固定化基板において基板全面にDNA固定化処理(PL L処理)がされていることや、また基板面が平らであることなどに起因する。

#### [0005]

さらに、スポッティング型のDNAマイクロアレイの場合、DNA検出スポット部の 周囲に付着した固相化剤の存在により、ターゲットDNAが非特異的に基板上に吸 着し、ノイズの上昇を引き起こし、S/N比を低下させるという問題もあった( 非特許文献 1 参照)。

#### [0006]

また、蛍光測定時において、蛍光部分を特定するグリッディングという操作が行われる。グリッディングは、アレイ上のスポットの縦横の数やスポット間隔、スポットの直径の大きさを入力し、スポットを円で囲む操作をいう(非特許文献 1参照)。しかし、スタンプ形状および位置が安定していないと、蛍光解析時のグリッディング操作に非常に時間がかかる上、正確な解析が困難となる。また、グリッディング操作に非常に時間がかかる上、正確な解析が困難となる。また、グリッディングは、スポットの位置がずれているとスポットを正確に囲むことが出来ないため、ソフトウェアに、自動で位置を補正する機能が付いている。しかるに、すべての操作が自動になっているわけではなく、手動でスポットの開始点の設定や目視によりすべてのスポットのグリットを確認し補正する必要がある。この操作は非常に煩雑であり、DNAスポットの数が数千以上になると非常に時間がかかる作業となり、解析スピードを遅らせる要因となっている。

# [0007]



一方、基板上に固定化されたプロープDNAと試料ターゲットDNAをハイブリダイゼーションさせるには、通常、十数時間要し、しかも、多量の試料ターゲットDNAが必要とされる。そのため、ハイブリダイゼーション時間および大量の試料の調製に、莫大な時間と費用、労力が必要とされている。特に、低発現遺伝子の解析を行う場合、極めて多くのターゲット試料が必要となる。

## [0008]

【非特許文献1】「必ずデータが出るDNAマイクロアレイ実践マニュアル 基本原理、チップ作製技術からバイオインフォマティクスまで」、第1版、羊土社、2002年12月1日、p. 19-21、35、106-108

## [0009]

## 【発明が解決しようとする課題】

そこで本発明の目的は、生体分子マイクロアレイに一定形状の生体分子固定化領域をもつ基板及び生体分子の相互作用、特に核酸のハイブリダイゼーションを高速に行い、かつ微量サンプルの相互作用を促進させ、さらに高速・高感度に相互作用を検出し解析する手段を提供することである。

更に、本発明は、生体分子の相互作用を促進して、相互作用し得る生体分子間で効率的に相互作用を形成させることができる相互作用促進用装置および方法を 提供することを目的とする。

更に、本発明は、グリッディング操作を自動で行う手段を提供することにより、生体分子マイクロアレイからの蛍光データの収集およびデジタル解析の自動化を可能にすることを目的とする。

より詳しくは、本発明は、高感度で生体分子の相互作用を検出でき、好ましくは、併せてグリッティングを自動で行うこともできる生体分子マイクロアレイ用 基板、そのような基板に生体分子が固定化された生体分子マイクロアレイを提供 することを目的とする。

更に、本発明は、グリッティングを自動で行うことを可能にする生体分子の相 互作用の検出方法を提供することを目的とする。

## [0010]

#### 【課題を解決するための手段】



上記本発明の目的を達成するための手段は、以下の通りである。

(1) 基板表面に、生体分子固定化用スポットを1つ以上有する生体分子マイクロアレイ用基板であって、

前記生体分子固定化用スポットが、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット 用平面を有し(以下、「突出スポット部」という)、かつ

少なくとも、前記突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およ びスポット用平面が、導電性物質からなることを特徴とする基板。

- (2)前記突出スポット部周辺の基板表面が、略V字型底面を形成する(1)に 記載の基板。
- (3) 基板表面に、生体分子固定化用スポットを1つ以上有する生体分子マイクロアレイ用基板であって、

前記生体分子固定化用スポットが、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット 用平面を有し(以下、「突出スポット部」という)、

隣り合う突出スポット部は、突出スポット部側面によって隣接しており、かつ

少なくとも、前記突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなることを特徴とする基板。

- (4)前記導電性物質が、金、ニッケル、白金、銀、チタン、アルミニウム、ステンレス、銅、導電性酸化物、または導電性プラスチックである(1)~(3)のいずれかに記載の基板。
- (5) 前記基板は、基板全体が導電性物質からなるか、または、基板表面に導電性物質被覆層を有する(1)~(4)のいずれか1項に記載の基板。
- (6)前記導電性被覆層を有する基板が、ガラス、金属、シリコン、またはプラスチックからなる(5)に記載の基板。
- (7)前記突出スポット部の高さが、 $10\sim500~\mu$  mである(1) $\sim$ (6)のいずれかに記載の基板。
- (8) 前記突出スポット部頂上のスポット用平面と前記突出スポット部側面とのなす角が、90度以上である(1)~(7)のいずれかに記載の基板。
  - (9) 前記スポット用平面が粗面化されている (1) ~ (8) のいずれかに記載



の基板。

- (10) (1) ~ (9) のいずれか1項に記載の基板および生体分子を含み、生体分子は、前記基板上の少なくともスポット用平面に固定化されていることを特徴とする生体分子マイクロアレイ。
- (11) 前記生体分子は、DNA、RNA、PNA、蛋白、ポリペプチド、糖化合物、脂質、天然低分子、および合成低分子からなる群から選ばれる少なくとも一種である(10) に記載の生体分子マイクロアレイ。
- (12) 基板上に1つ以上の生体分子固定化スポットを有する生体分子マイクロアレイ、

前記マイクロアレイの生体分子固定化スポットを有する面に対向するように設けられた電極、および

前記マイクロアレイと前記電極との間に電界を印加するための電源 を有する、生体分子の相互作用促進用装置であって、

前記生体分子マイクロアレイを構成する基板は、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有する生体分子固定化用スポット(以下、「突出スポット部」という)を有し、

少なくとも前記突出スポット部は導電性物質表面を有し、

前記スポット用平面の導電性物質表面に生体分子が固定化され、前記生体分子 固定化スポットが形成されており、かつ

前記基板は、前記基板上の突出スポット部以外の表面に、前記突出スポット部の導電性物質表面と通電可能な端子を有することを特徴とする、生体分子の相互作用促進用装置。

- (13) 前記基板上の突出スポット部以外の表面は、導電性物質被覆層を有し、 前記端子は、前記導電性物質被覆層に含まれるか、または、前記導電性物質被覆 層と通電可能であり、かつこの導電性物質被覆層と突出スポット部の導電性物質 表面とは、一体の導電性物質被覆層として設けられている(12)に記載の装置
- (14) 前記生体分子マイクロアレイが、(10) または(11) に記載の生体分子マイクロアレイである(12) または(13) に記載の装置。



- (15) 前記スポット用平面と電極との距離が、 $1\sim500\,\mu$  mである(12)  $\sim$  (14) のいずれかに記載の装置。
- (16) 前記マイクロアレイと電極との間に、非導電性スペーサーを有する (12)  $\sim$  (15) のいずれかに記載の装置。
- (17) 前記マイクロアレイの生体分子スポットを有する面に対向するように設けられた電極が、透明電極である(12)~(16) のいずれかに記載の装置。
- (18) 温度制御手段を更に有する(12)~(17) のいずかに記載の装置。
- (19) (12) ~ (18) のいずれかに記載の装置を用いる、生体分子の相互 作用促進方法であって、

前記マイクロアレイと電極との間に、ターゲット生体分子を含む溶液を配置し、かつ、

前記マイクロアレイと電極との間に電界を印加することを特徴とする、生体分子の相互作用促進方法。

- (20) 前記マイクロアレイと電極との間に印加される電界が、0.001~10 MV/mである(19) に記載の方法。
- (21)前記ターゲット生体分子が、蛍光標識されている請求項19または20 に記載の方法。
- (22) ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれているか、または、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれていた(10)または(11)に記載のマイクロアレイの各生体分子固定化スポット上の生体分子と前記ターゲット生体分子との間の相互作用を、共焦点型検出器によって検出することを特徴とする生体分子の相互作用の検出方法。
- (23)前記マイクロアレイは、(19)~(21)のいずれかに記載の方法を 用いて、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれているか、または 、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれていた、(22)に記載 の方法。
- (24) 前記固定化スポット上の生体分子および/または前記ターゲット生体分子が蛍光標識されている(22) または(23) に記載の方法。
  - (25) 前記共焦点型検出器によって、マイクロアレイ表面の突出スポット部と



それ以外の部分の高さおよび/または形状の差による反射光強度の相違から、マイクロアレイ上の前記突出スポット部を反射像として検出する(22)~(24)のいずれかに記載の方法。

(26)前記反射像として検出された突出スポット部からの蛍光を検出することにより、生体分子の相互作用を検出する(25)に記載の検出方法。

## [0011]

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明について更に詳細に説明する。

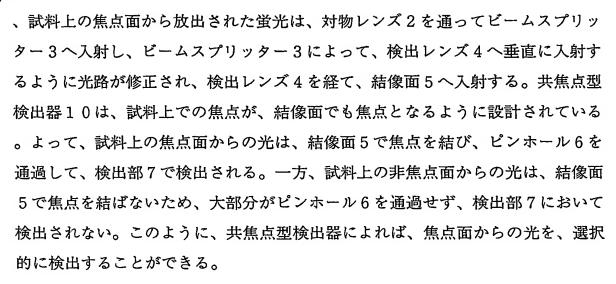
#### [基板]

本発明の生体分子マイクロアレイ用基板は、基板表面に、生体分子固定化用スポットを1つ以上有する生体分子マイクロアレイ用基板であって、前記生体分子固定化用スポットが、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有する(以下、「突出スポット部」という)。更に、本発明の生体分子マイクロアレイ用基板は、少なくとも、前記突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およびスポット用平面が、導電性物質からなるか(以下、「第一の態様」という)、または、隣り合う突出スポット部は、突出スポット部側面によって隣接しており、かつ、少なくとも、前記突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなる(以下、「第二の態様」という)ことを特徴とする。

本発明の基板では、生体分子固定化用スポットが、突出スポット部の頂上の平面に設けられている。そのため、本発明の第一の態様の基板では、前記突出スポット部頂上のスポット用平面(生体分子固定化用スポット)は、前記突出スポット部周辺の基板表面より一段高い位置にあり、両者間に高低差が生じる。

# [0012]

一方、本発明において、生体分子の相互作用の検出に用いられる共焦点型検出器は、試料上の焦点面からの反射光や蛍光を、光学系の結像面に置かれたピンホールに通して検出する。図1に、本発明で使用される共焦点型検出器10の光学系の概略図を示す。図1の実線aは、入射光を表す。実線bは、焦点面からの反射光または蛍光を表し、破線は、非焦点面からの反射光または蛍光を表す。共焦点型検出器10では、マイクロアレイ1上の焦点面から反射した反射光、および



#### [0013]

本発明の第一の態様の基板では、前記突出スポット部周辺の基板表面と、前記 突出スポット部頂上のスポット用平面(生体分子固定化用スポット)との高低差 が、生体分子とターゲット生体分子との相互作用の検出において使用する共焦点 型検出器の焦点深度以上であれば、共焦点型検出器の焦点を、突出スポット部頂 上のスポット用平面の高さに合わせることにより、検出器において、突出部周辺 の基板表面からの蛍光や反射光よりも、突出スポット部頂上のスポット用平面か らの蛍光や反射光を、より高い強度で検出することができる。従って、本発明の 基板の突出スポット部頂上のスポット用平面に生体分子を固定化したマイクロア レイでは、スポット上の情報、例えば、ターゲット生体分子との相互作用の有無 を、高感度で検出することができる。

#### [0014]

本発明の第二の態様の基板は、隣り合う突出スポット部が、突出スポット部側面によって隣接しており、かつ、少なくとも、前記突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなることを特徴とする。本発明の第二の態様の基板の一例を、図5に示す。

#### [0015]

本発明の第一および第二の態様の基板において、前記突出スポット部頂上のスポット用平面と前記突出スポット部側面とのなす角は、90度以上であることが好ましい。好ましくは、90~135度である。図2(a)は、本発明の基板の



一部の断面図である。ここで、「突出スポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面とのなす角」とは、図 2 (a) における角度  $\theta$  をいう。角度  $\theta$  は、例えば、突出スポット部を、突出スポット部周辺の基板表面に対して垂直に切断し、その断面から求めることができる。

## [0016]

このように、本発明の基板において、突出スポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面とのなす角が90度以上であることにより、即ち、突出スポット部底面の大きさが、突出スポット部頂上のスポット用平面の大きさ以上であることにより、グリッティングを自動で行って、生体分子固定化用スポットの位置および大きさを特定することができるという利点がある。以下に、この点について、詳述する。

#### [0017]

図2(a)に示すように、突出スポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面とのなす角が90度以上である場合、共焦点型の検出器を使用して反射光を検出する際に、突出スポット部頂上のスポット用平面に対して垂直な方向から照射した光(図2(a)に矢印で表される光)に対する突出スポット部側面からの反射光は、入射光と同一方向には反射しない。一方、突出スポット部頂上のスポット用平面からの反射光は、入射光と同一方向に反射する。このため、共焦点型検出器では、突出スポット部頂上のスポット用平面からの反射光のみが検出され、側面からの反射光は検出されない。こうして得られた反射像には、突出スポット部頂上のスポット用平面に相当する像が、反射像として得られ、突出スポット部頂上のスポット用平面に相当する像が、反射像として得られ、突出スポット部側面に相当する部分は、反射光がほとんど検出されないので黒色の縁取りとして表れる。この反射像では、黒い縁取りの内部が生体分子スポットに相当するため、この反射像により、スポットの大きさおよび位置を特定することができる。本発明では、このような原理により、自動グリッティングを行うことが可能である。

#### [0018]

また、本発明の第一の態様の基板において、突出スポット部の高さが相互作用 の検出に使用する共焦点型検出器の焦点深度以上である場合は、共焦点型検出器



の焦点を、突出スポット部頂上のスポット用平面の高さに合わせれば、突出スポット部頂 ット部周辺の基板表面からの反射光は、焦点が合わないため、突出スポット部頂 上のスポット用平面からの反射光よりもはるかに弱い強度でしか、検出されない。本発明では、この高低差を利用して自動グリッティングを行うことも可能である。但し、前記突出スポット部の高さが相互作用の検出に使用する共焦点型検出 器の焦点深度より小さい場合であっても、前述のように、反射像において、突出スポット部側面に相当する部分が黒色の縁取りとして表れれば、スポットの大きさおよび位置を特定することが可能である。

## [0019]

また、本発明の第一の態様の基板では、前記突出スポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面とのなす角が90度未満であっても、突出スポット部の高さが相互作用の検出に使用する共焦点型検出器の焦点深度以上である場合は、スポット用平面と、突出スポット部周辺の基板表面との高低差を利用して、反射像によって、スポット用平面の位置および大きさを特定し、自動でグリッティングを行うことができる。前記突出スポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面とのなす角が90度である場合、前記突出スポット部の形状は、例えば、円柱状または角柱状であることができる。

#### [0020]

さらに、本発明の第一の態様の基板は、前記突出スポット部頂上のスポット用平面と前記突出スポット部側面とのなす角が、90度以上であり、かつ、前記突出スポット周辺の基板表面が、略V字型底面を形成する基板であることもできる。このような基板では、共焦点型検出器で検出されるスポット用平面からの反射光強度が、基板上のスポット用平面以外の部分からの反射光強度より強くなるため、この反射光強度の違いにより、スポット用平面の位置および大きさを特定することができる。図4は、「略V字型底面」を有する基板の一部の拡大図である。本発明において、「略V字型底面」とは、例えば、隣り合う突出スポット部間の突出スポット部周辺の基板表面が平面ではなく、図4に示すように、略V字を形成していることをいう。

# [0021]



更に、本発明の第一の態様の基板は、少なくとも、前記突出スポット部周辺の 基板表面、突出スポット部側面、およびスポット用平面が、導電性物質からなる ことを特徴とする。製造の容易さや製造コストを考慮すれば、本発明の第一の態 様の基板は、基板上の、前記突出スポット周辺以外の基板表面も、導電性物質か らなるものであることが好ましい。また、本発明の第二の態様の基板は、少なく ともと突出スポット部側面および突出スポット部平面が、導電性物質からなるこ とを特徴とする。

## [0022]

本発明では、前記のように、第一の態様の基板においては、少なくとも、突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およびスポット用平面が、第二の態様の基板においては、少なくとも、突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなることにより、後述するように、前記基板に対向する電極を設け、電界を印加することによって、スポット用平面に固定化された生体分子とターゲット生体分子との相互作用を促進することができる。例えば、ターゲット生体分子の濃度が低い場合でも、良好な相互作用結果を得ることができ、また、濃度が同一の場合には、より短時間で所定の相互作用結果を得ることができる。

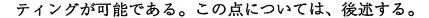
#### [0023]

また、本発明では、前記導電性物質が、光を反射する性質を有するものであれば、反射光によって、生体分子固定化スポットの大きさおよび位置を特定し、自動でグリッティングを行うことができる。この点については後述する。

#### [0024]

本発明において、前記突出スポット部の高さは、相互作用の検出において使用する共焦点型検出器の焦点深度以上の高さになるように、適宜設定することができ、通常の共焦点型検出器の焦点深度を考慮すると、例えば、10~500μmであることができる。但し、前述のように、基板上の突出スポット部頂上のスポット用平面とそれ以外の部分との形状の差による反射光強度の相違を検出することによって自動グリッティングを行う場合は、前記突出スポット部の高さは、相互作用の検出に使用する共焦点型検出器の焦点深度より小さくても、自動グリッ





また、前記突出スポット部の高さを決定する際は、生体分子のスポット形成(スタンピング)に使用するニードルの直径や、プローブ核酸等の生体分子溶液のスポット量も考慮する必要がある。例えば、直径 $100\mu$ mの円形の突出スポット部に対して直径 $130\mu$ m程度のニードルを用いて生体分子をスポットする場合、突出スポット部の高さが $15\mu$ m以上であれば、表面張力のため、突出スポット部頂上のスポット用平面から生体分子溶液が流れ出すことなく、固定化用スポットのみに、生体分子が固定化されるため、好ましい。

#### [0025]

本発明の基板において、突出スポット部頂上のスポット用平面の形状は、スポットされた生体分子を保持し得る形状であれば、いずれの形状であることもでき、例えば、円形や正方形であることができる。前記スポット用平面の大きさは、スポットに用いるニードルやスポットする生体分子溶液の量に応じて適宜設定することができ、例えば、10~500µmとすることができる。ここで、「スポット用平面の大きさ」とは、例えば、スポット用平面の形状が円形の場合は、その直径をいい、スポット用平面の形状が正方形の場合は、その一辺の長さをいう

突出スポット部底面の形状は、特に限定されないが、製造の容易さ等を考慮すれば、スポット用平面と同様の形状であることが好ましい。図2(b)は、本発明の基板上の突出スポット部の概略図である。ここで、「突出スポット部底面の形状」とは、図2(b)の斜線部をいう。

## [0026]

前記突出スポット部頂上のスポット用平面は、粗面化されていてもよい。例えば、前記突出スポット部頂上のスポット用平面は、深さ方向と略水平方向に、相互作用の検出において使用する共焦点型検出器の焦点深度以内の深さの凹凸を有していてもよい。図3に、粗面化されたスポット用平面の一例(部分拡大図)を示す。粗面化されたスポット用平面の一例としては、図3に示すような、数μm角の格子状の形状を設けたスポット用平面を挙げることができる。このように、スポット用平面が粗面化されていることにより、後述するように、電気泳動また



は誘電泳動によるターゲット生体分子の濃縮効果を得る場合に、凹凸の角(エッジ)部分に強電界が生じ、相互作用が更に促進されるという利点がある。

#### $[0\ 0\ 2\ 7]$

スポット用平面の粗面化方法は特に限定されず、例えば、本発明の基板がプラスチック成型基板の場合、フォトリソグラフィーによりエッチングした母材を、電鋳法により反転写した微細加工金型を用いることにより、スポット用平面が粗面化された基板を製作することができる。

#### [0028]

本発明の基板は、基板全体が導電性物質からなるか、また、基板表面に導電性 物質被覆層を有するものであることができる。

前述のように、反射像によって自動グリッティングを行う場合には、前記導電 性物質は、光を反射する性質を有する物質から選択する。

また、金属とチオール基との結合を利用して、プローブ核酸の固定化を行う場合は、前記導電性物質は、チオール基と結合性を有する金属から選択する。

# [0029]

前記導電性物質としては、例えば、金属(例えば、金、ニッケル、白金、銀、チタン、アルミニウム、ステンレス、銅)、導電性酸化物(例えば、 $In_2O_5/SnO_2$ )および導電性プラスチック(例えば、ポリアセチレン)を挙げることができる。

また、導電性物質被覆層を有する基板としては、ガラス、シリコン、プラスチック、具体的には、ポリプロピレン等の基板の表面に、前記導電性物質を被覆したものを挙げることができる。基板上の導電性物質被覆層の厚さは、特に限定されるものではなく、例えば、 $0.1\sim10~\mu$  mとすることができる。

#### [0030]

本発明において、前記基板が、金属からなるものである場合は、所望の形状の 突出スポット部に対応した凹部を有する鋳型に、熔融した金属を注入して鋳造す ることにより、本発明の基板を得ることができる。また、プレス成形によって、 金属製基板を得ることもできる。本発明の基板は、金属からなる基板の上に、導 電性物質を被覆したものであることもできる。



#### [0031]

本発明の基板が、シリコンまたはプラスチック製の基板上に導電性物質の被覆を有するものである場合は、例えば、所望の形状の突出スポット部に対応した凹部を有する成形型を用いてシリコンまたはプラスチックを成形し、そのシリコンまたはプラスチック製の基板上に、導電性物質を、蒸着、メッキ等によって被覆することにより、本発明の基板を得ることができる。

## [0032]

また、本発明の基板は、平板状の基板上に導電性被覆層を被覆した後に、エッチング等により突出スポット部を形成することによって製造することもできる。

## [0033]

次に、本発明の基板が、ガラス基板上に金被覆層を有するものである場合の、 基板の製造方法の一例を説明する。但し、本発明はこの態様に限定されるもので はない。

まず、スライドガラスの表面に、真空蒸着装置により、クロム、チタン、ニッケル等を蒸着し、次いで、その上に金を蒸着する。この金蒸着スライドガラス上に、ポジ型レジストをスピンコーターで塗布し、例えば60℃でオーブンにより1時間ベーキングする。

次いで、紫外線露光装置により、フォトマスクを通してスライドガラスに紫外線を照射する。このとき、フォトマスクとしては、所望の形状の突出スポット部に対応したパターンを有するものを使用する。紫外線照射後、現像液によって現像を行えば、金蒸着スライドガラス表面に、レジストパターンを形成することができる。

## [0034]

次いで、レジストパターン周辺の金表面を、金エッチャントによってエッチングする。金エッチング後の基板を超純水によって洗浄した後、金の下に蒸着されたクロム、チタン、ニッケル等を除去するために、エッチャントにより更にエッチングを行い、超純水によって洗浄する。

アセトン等によってレジストを溶解した後、超純水によって洗浄し、更に残っているレジストを完全に除去するために、ピラニア溶液 (硫酸:過酸化水素=1





:1) に例えば10分間漬けて、超純水で洗浄する。これにより、フォトマスクに対応した金パターンを有するガラス基板を得ることができる。

## [0035]

次に、上記基板を、フッ化水素酸に浸漬し、露出しているガラス表面をエッチングする。このときに使用するフッ化水素酸の濃度および浸漬時間は、所望の突出スポット部の高さに応じて適宜設定することができる。

## [0036]

次に、前述と同様に、金およびクロム等のエッチングを行った後、ピラニア溶液および超純水によって基板を洗浄し、所望の形状の突出スポット部を有するガラス基板を得ることができる。

このガラス基板に、前述と同様に、クロム等を蒸着し、次いで、金を蒸着する ことによって、突出部を有し、かつ、金被覆を有する基板を得ることができる。

#### [0037]

本発明において、基板全体の大きさ、基板上の突出スポット部の数および集積度は特に限定されず、適宜設定することができる。例えば、本発明の基板は10~20, 000mm $^2$ の大きさの基板上に、突出スポット部を、10~50, 000個程度有するものであることができる。

#### [0038]

# [生体分子マイクロアレイ]

本発明の核酸マイクロアレイは、本発明の基板および生体分子を含み、生体分子は、前記基板上の少なくともスポット用平面に固定化されていることを特徴とする生体分子マイクロアレイである。前記生体分子は、DNA、RNA、PNA、蛋白、ポリペプチド、糖化合物、脂質、天然低分子、および合成低分子からなる群から選ばれる少なくとも一種であることができ、目的に応じて選択することができる。

ここで、糖化合物としては、例えば、単糖、オリゴ糖、多糖、糖鎖複合体、糖 蛋白質、糖脂質、およびそれら誘導体などを挙げることができる。

脂質としては、例えば、脂肪酸、リン脂質、糖脂質、グリセリドなどを挙げる ことができる。



天然低分子としては、例えば、ホルモン分子や抗生物質、毒物、ビタミン類、 生理活性物質、二次代謝産物などを挙げることができる。

合成低分子としては、例えば、天然低分子の合成物、およびそれら誘導体など を挙げることができる。

## [0039]

本発明では、生体高分子が核酸であり、かつ、前記導電性物質が金属である場合、プローブ核酸を生体分子固定化用スポット(突出スポット部)に固定化するために、突出スポット部頂上のスポット用平面の金属と反応性を有する基を一端に有する核酸を含む溶液を、スポッティング溶液として用いることができる。そのような基としては、チオール基を挙げることができる。チオール基を有する核酸鎖の金属表面への固定化は、公知の方法によって行うことができ、例えば、J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 9787-9792を参照することができる。

#### [0040]

金属表面へのDNAの固定化方法としては、金属(表面酸化被膜を活性化させ 水酸基を提示させたもの)に対して以下の処理を行う方法を用いることもできる。

- (1) アミノシラン処理した基板表面に、UV照射することにより、DNAを固定化する。
- (2) アミノシラン、NHS (N-ヒドロキシスクシンイミド)-ビオチン、アビジンによって順次処理した基板表面に、ビオチン化DNAを固定化する。
- (3) アミノシラン、マレイミド-ビオチン、アビジンによって順次処理した基板表面に、ビオチン化DNAを固定化する。
- (4) アミノシラン、次いでグルタルアルデヒドによって処理した基板表面に、 アミノ化DNAを固定化する。
- (5) アミノシラン、次いでカルボジイミドによって処理した基板表面に、アミノ化DNAを固定化する。
- (6) アミノシラン処理した基板表面に、カルボキシ化DNAを固定化する。
- (7) アミノシラン処理した基板表面に、リン酸化DNAを固定化する。
- (8) アミノシラン、次いでNHS-マレイミド化合物によって処理した基板表面



に、チオール化DNAを固定化する。

- (9) エポキシシラン処理した基板表面に、アミノ化DNAを固定化する。
- (10) チオールシラン処理した基板表面に、チオール化DNAを固定化する。

## [0041]

また、DNA以外の生体分子についても、上記のような、UV照射による固定化や、チオール基、アミノ基、カルボキシル基、リン酸基などの官能基を介しての固定化が可能である。

## [0042]

前記スポット用平面への生体分子溶液のスポッティングは、常法により行うことができ、例えば、先端に生体分子溶液を保持したニードルを、突出スポット部頂上のスポット用平面に接触させることにより行うことができる。ここで使用されるスポッティング用装置としては、例えば、特開2001-46062号公報および特開2003-57236号公報に記載の装置を挙げることができる。スポット量は、スポット用平面から生体分子溶液が流れ出さないように、スポット用平面の大きさや、突出スポット部の高さに応じて、適宜設定することができる。

# [0043]

[相互作用促進用装置、相互作用促進方法]

本発明は更に、

基板上に1つ以上の生体分子固定化スポットを有する生体分子マイクロアレイ、 前記マイクロアレイの生体分子固定化スポットを有する面に対向するように設 けられた電極、および

前記マイクロアレイと前記電極との間に電界を印加するための電源 を有する、生体分子の相互作用促進用装置であって、

前記生体分子マイクロアレイを構成する基板は、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有する生体分子固定化用スポット(突出スポット部)を有し、

少なくとも前記突出スポット部は導電性物質表面を有し、

前記スポット用平面の導電性物質表面に生体分子が固定化され、前記生体分子



固定化スポットが形成されており、かつ

前記基板は、前記基板上の突出スポット部以外の表面に、前記突出スポット部の導電性物質表面と通電可能な端子を有することを特徴とする、生体分子の相互 作用促進用装置

に関する。このような生体分子の相互作用としては、例えば、プローブ核酸とターゲット核酸とのハイブリダイゼーション、抗原一抗体相互作用、レセプターーリガンド相互作用、タンパクータンパク相互作用、DNAータンパク相互作用を挙げることができる。

前記基板上の突出スポット部以外の表面は、導電性物質被覆層を有し、前記端子は、前記導電性物質被覆層に含まれるか、または、前記導電性物質被覆層と通電可能であり、かつこの導電性物質被覆層と突出スポット部の導電性物質表面とは、一体の導電性物質被覆層として設けられていることが好ましい。前記装置における生体分子マイクロアレイは、前記本発明の生体分子マイクロアレイであることができる。

## [0044]

更に、本発明は、前記の生体分子の相互作用促進用装置を用いる、生体分子の 相互作用促進方法であって、

前記マイクロアレイと電極との間に、ターゲット生体分子を含む溶液を配置し、かつ、

前記マイクロアレイと電極との間に電界を印加することを特徴とする、生体分子の相互作用促進方法 に関する。

# [0045]

前記装置における生体分子マイクロアレイは、突出スポット部を有するため、マイクロアレイ上の突出部頂上の生体分子が固定化された平面と、前記マイクロアレイの生体分子スポットを有する面に対向するように設けられた電極 (対向電極) の、前記平面と対向する面との間で電界密度が高まり、溶液中のターゲット生体分子が、電気泳動 (直流電源を使用した場合)または誘電泳動 (交流電源を使用した場合)によって突出部近傍に濃縮される。



これにより、突出スポット部に固定化された生体分子と、ターゲット生体分子との相互作用を促進させることができる。特に、前記生体分子マイクロアレイにおいて、生体分子が固定化されたスポット平面が粗面化されている場合、例えば、スポット平面に、共焦点型検出器の焦点深度以内で深さ方向と略水平方向に凹凸を有する場合は、凹凸の角(エッジ)部分に強電界が生じ、相互作用が更に促進されるという利点がある。

## [0046]

前記対向電極は、前記生体分子マイクロアレイと対向電極との間に電界を印加することができるものであれば、特に制限はない。図6 (a)に、本発明の生体分子の相互作用促進用装置の概略図を、図6 (b)に、本発明の生体分子の相互作用促進用装置の断面図を示す。本発明において、対向電極は、導電性物質、例えば、金属、導電性酸化物、導電性プラスチック、等からなる基板であることができ、また、マイクロアレイと対向する面に、導電性物質被覆層を有する基板からなるものであることもできる。本発明では、特に、前記対向電極が、例えば、ITO(酸化インジウムスズ)、酸化スズなどの透明電極であれば、生体分子の相互作用中に、同時に、透明電極の上から、共焦点型検出器で反射光および蛍光の検出を行うことができ、相互作用をリアルタイムで検出することができる。また、前記生体分子マイクロアレイを構成する基板が、光透過性のガラスやプラスチック上に、透明の導電性被覆層を設けたものである場合や、基板全体が透明の導電性物質からなる場合も、同様に、相互作用をリアルタイムで検出することができる。

#### [0047]

また、前記相互作用促進用装置において、生体分子マイクロアレイと対向電極との間に電界を印加するための電源は、直流電源でも、交流電源でもよく、より好ましくは、交流電源が用いられる。直流電源を使用する場合は、高電圧をかけると、ターゲット生体分子溶液が高電圧により電気分解し、気泡等が発生しやすいという懸念があるため、低電圧を使用することが好ましい。ターゲット生体分子としてDNAを使用する場合には、DNAがマイナスに荷電されているため、直流電源を使用する場合は、突出スポット部側が、プラスになるように電界を印



加することが好ましい。交流電源を使用する場合は、低周波交流では、ターゲット生体分子溶液の電気分解により気泡等が発生しやすいという懸念があるため、 高周波交流を使用することが好ましい。

## [0048]

前記相互作用促進用装置において、生体分子マイクロアレイと対向電極との間には、生体分子マイクロアレイの突出スポット部を有する領域が覆われないように、非導電性材料からなるスペーサーを挟むことができる。前記非導電性材料としては、例えば、ゴム、ガラス、プラスチックを挙げることができる。本発明の装置では、このスペーサーの厚さにより、生体分子マイクロアレイ上のスポット用平面と対向電極との距離を設定することができ、また、このスペーサーによって囲まれた空間に、ターゲット生体分子を含む溶液を充填することができる。前記スポット用平面と対向電極との距離は、電気泳動または誘電泳動によるターゲット生体分子濃縮の効果が得られる範囲で適宜設定することができ、例えば、1~500 $\mu$ mとすることができる。

## [0049]

前記相互作用促進用装置は、ヒーター等の温度制御手段を更に有することが好ましい。温度制御手段によって、生体分子周辺の環境を、相互作用に適した温度に制御することにより、相互作用を更に促進することができる。

#### [0050]

前記装置において、生体分子マイクロアレイと対向電極との間に印加される電界は、前記の生体分子マイクロアレイと対向電極との間の距離を考慮しつつ、電気泳動または誘電泳動によるターゲット生体分子の濃縮の効果が得られる範囲で適宜設定することができ、例えば、0.001~10MV/mとすることができる。

#### [0051]

本発明では、共焦点検出器によって蛍光を検出することにより生体分子間の相互作用を検出するために、前記の相互作用促進方法に用いられるターゲット生体分子は、蛍光標識されているものであることが好ましい。ターゲット生体分子の蛍光標識は、公知の方法で行うことができる。また、本発明では、マイクロアレ



イに固定化される生体分子が、蛍光標識されていてもよい。マイクロアレイに固定される生体分子の蛍光標識も、公知の方法で行うことができる。

## [0052]

本発明において、ターゲット生体分子溶液に用いるバッファーとして、好ましいものとしては、約6~8付近の解離定数(pKa)を有するものが挙げられる。プローブ核酸とターゲット核酸とのハイブリダイゼーションを効率よく起こさせるためには、pHが中性域であることが好ましいため、中性域で緩衝能を有するバッファーを使用することが好ましい。具体的には、以下のバッファー物質を含むバッファーが挙げられる;ヒスチジン、MES (2-(N-モルホリン)エタンスルホン酸)、マレイン酸、3,3-ジメチルグルタル酸、炭酸、4-ヒドロキシメチルイミダブール、クエン酸、ジメチルアミノエチルアミン、プロリン酸、グリセロール-2-リン酸、PIPES (ピペラジン-N,N'-ビス(2-エタンスルホン酸))、エチレンジアミン、イミダゾール、MOPS (3-(N-モルホリン)プロパンスルホン酸)、リン酸、TES (N-トリス(ヒドロキシメチル)メチル-2-アミノエタンスルホン酸)、4-メチルイミダブール、HEPES (N-2-ヒドロキシエチルピペラジン-N'-2-エタンスルホン酸)、N-エチルモルホリン、トリエタノールアミン、トリス(トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン)。

#### [0053]

#### 「相互作用の検出方法】

本発明は更に、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境に置かれているか、または、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境に置かれていた、本発明のマイクロアレイの各生体分子固定化スポット上の生体分子と前記ターゲット生体分子との間の相互作用を、共焦点型検出器によって検出することを特徴とする生体分子の相互作用の検出方法にも関する。共焦点型検出器による反射光および蛍光の検出原理については、前述の通りである。本発明の相互作用の検出方法では、共焦点型検出器を用いて、前述の原理で反射像によってスポットの大きさおよび位置を特定することで、自動グリッティングを行うことができる。即ち、本発明によれば、マイクロアレイ表面の生体分子固定化スポットとそれ以外の部分の高さおよび/または形状の差による反射光強度の相違から、マイクロアレイ上の生



体分子固定化スポットを、反射像として検出することができる。更に、共焦点型 検出器によって、マイクロアレイからの蛍光を検出するときに、マイクロアレイ 上の突出スポット部頂上のスポット平面の高さに、共焦点型検出器の焦点を合わ せれば、前記スポット平面上の蛍光標識された生体分子(スポットに固定化され た生体分子および/またはターゲット生体分子)からの蛍光を選択的に検出して 、スポットに対応する蛍光像を得ることができる。本発明では、こうして得られ た反射像と蛍光像を重ね合わせることによって、マイクロアレイ上の相互作用が 起こっているスポットを特定することができ、その蛍光強度により、相互作用の 程度を測定することができる。なお、本発明では、インターカレーターを用いて 、インターカレーターからの蛍光を測定することによって相互作用を検出するこ ともできる。

#### [0054]

特に、本発明では、反射光と蛍光とを同時に検出することができる共焦点型スキャナーを用いることが好ましい。そのような装置の一例を、図7に示す。図7に示す装置では、励起光源(レーザー)21から発生した励起光はミラー22、ダイクロックミラーミラー23、ミラー26、対物レンズ24、を介して試料(マイクロアレイ)25に照射される。反射光は対物レンズ24、ミラー26、ダイクロックミラー23(反射光の一部を透過(数パーセント以下))、ダイクロックミラー27、減光フィルター28、検出レンズ29、ピンホール30を介して反射光検出部31に導かれる。蛍光は2つのダイクロックミラー23、27を透過し、ミラー32にて反射しカットフィルター33、検出レンズ34、ピンホール35を介して蛍光検出部36に導かれる。このような装置によれば、マイクロアレイ表面の生体分子固定化スポットとそれ以外の部分の高さおよび/または形状の差による反射光強度の相違から、マイクロアレイ上の生体分子固定化スポットを反射像として検出し、同時に、そのスポットからの蛍光を検出することによって、生体分子の相互作用を検出することができる。

#### [0055]

#### 【実施例】

以下、本発明を実施例によって更に説明する。





#### 実施例1

# 核酸マイクロアレイ用基板の作製

- 1)表面研磨したスライドガラスの表面に、真空蒸着装置により、クロムを250Å厚で蒸着した後、金をその上に2500Å厚で蒸着した。
- 2) 金蒸着スライドガラス上にポジ型レジストS1813 (シプレー社) をスピンコーターで塗布し、60 $^{\circ}$ オーブンにより1時間ベーキングした。
- 3)紫外線露光装置により、フォトマスクを通して上記スライドガラスに紫外光を照射した。フォトマスクは、直径  $200\mu$  mの円と 1 辺  $200\mu$  mの正方形のパターンがそれぞれ  $11\times11$  個形成されているものを使用した。照射後、現像液 CD-26(シプレー社)により現像を行い、直径約  $200\mu$  mの円と正方形のレジストパターンを金表面上に形成した。
- 4) 円と正方形のレジストパターンの周辺分の露出している金表面を金エッチャント(ヨウ化カリウム:ヨウ素:水=6:1:80)により金をエッチングした。超純水で洗浄した後、金のエッチングにより露出したクロムをクロムエッチャント(10%硝酸二セリウムアンモニウム(IV))によりエッチングを行い、超純水で洗浄した。
- 5) アセトンにつけ、レジストを溶解後、超純水で洗浄し、さらに残っているレジストを完全に除去するために、ピラニア溶液(硫酸:過酸化水素=1:1) に10分間つけ、超純水で洗浄した。この段階で、ファトマスク通りに円と正方形の金パターンを有するガラス基板が作製された。
- 6)次に露出しているガラス表面をエッチングするために、上記の金パターンガラス基板を 4.6% フッ化水素酸に 50 分間浸漬した。これにより、ガラス表面は、約  $50\mu$  mの深さ分だけ腐食され、またアンダーカットにより金パターンの下も横方向から侵食され、直径約  $200\mu$  mの円と 1 辺約  $200\mu$  mの正方形のパターンは、約  $90\mu$  m(直径又は 1 辺)のパターンとなった。
- 7) 4) と同様に、金とクロムのエッチングを行った後、ピラニア溶液、超純水で基板を洗浄した。
- 8) 1) と同様に、クロムと金を蒸着し、金が表面に蒸着された核酸マイクロアレイ用基板を作製した(図8)。



## [0056]

図8 a) は、実施例1で作製された基板をデジタルカメラにて撮影したものである。凹凸が形成されていることが像からわかる。図8 b) は、正方形のスポットについて、共焦点顕微鏡により光学切片を撮像し、3次元構築したものである。基板上に、頂上にスポット用平面を有する突出スポット部が形成されていることがわかる。正方形のスポットの高さは、約50 $\mu$ mの高さを有していた。実施例1で得られた基板上のスポット用平面の大きさは、90 $\mu$ mであり、突出スポット部周辺の基板表面と、突出スポット部側面とのなす角は、110度であった。

#### [0057]

#### 実施例 2

核酸マイクロアレイ用基板へのDNAスタンピング

5' 一蛍光色素Cy3を標識したDNA溶液(tatgacaatg aatacggcta cagcaa cagg gtggtggacc tcatg (配列番号1) (遺伝子名GAPDH) 溶液組成:50μM 1×マイクロスポッティング溶液(テレケム社))を、理研で開発したD NAアレイヤーにより、実施例1で作製した核酸マイクロアレイ用基板の突出ス ポット部頂上のスポット用平面へスタンプした。スタンプ針の先端は、直径13 0μmの円形であった。図7に示す蛍光と反射光とを同時に計測することができ るDNAマイクロアレイスキャナーによって、DNA溶液をスタンプした基板か らの蛍光および反射光の計測を行った(図9)。(a)が蛍光像、(b)が反射 光像、(c)が二つの画像の重ね合わせである。ここで使用したDNAマイクロ アレイスキャナーでは、蛍光像は赤色で、反射像は緑色で表示される。円形のス ポットでは、赤色で表示された円形の蛍光像が観察でき、また、正方形のスポッ トでは、赤色で表示された正方形の蛍光像が観察できた。また、これらの蛍光像 を、緑色で表示された反射像と重ね合わせたところ、蛍光像のスポットの形と一 致したことから、DNAスタンプ溶液が、基板上の突出スポット部頂上のスポッ ト用平面のみにスタンピングされたことが証明された。このように、本発明の基 板によれば、反射像により、基板上の突出スポット部頂上のスポット用平面の位 置および大きさを認識し、DNAがスタンプされた領域を特定することができる



なお、本実施例で使用したスキャナーの反射用の焦点深度は $500\mu$ mであったため、突出スポット部周辺の基板表面(突出スポット部頂上のスポット平面との高低差: $50\mu$ m)からの反射光も、スポット平面からの反射光とほぼ同様の強度で検出された。但し、本実施例では、突出スポット部周辺の基板表面と、突出スポット部側面とのなす角が、110度であったため、反射像で、側面部に相当する部分が黒い縁取りとして表れることにより、スポットの位置および大きさを特定することができた。

[0058]

#### 実施例3

電気泳動によるハイブリダイゼーションの促進効果の検証 (直流電荷)

実施例1で得られた核酸マイクロアレイ用基板の突出スポット部頂上のスポット用平面に、チオール化DNAプローブ (tatgacaatg aatacggcta cagcaacagg gtgg tggacc tcatg(配列番号2)、遺伝子名GAPDH) を固定化し、蛍光標識マウス脳 c R N A をターゲットとしてハイブリダイゼーションを行った。

DNAマイクロアレイとITO電極を向かい合うようにし、その間に絶縁のために 0.17mmのガラスをはさみ、基板と電極とをクリップにより固定した。 0.17mmの空間に上記ターゲットを含有するハイブリダイゼーション溶液(  $cRNA:1.45\mu g (mRNA 0.05\mu g に相当)、ハイブリダイゼーション溶液( <math>2mm$  ションバッファー:2mm 50 mM とスチジン)を入れ、DNAマイクロアレイ側には、プラス電極をつなぎ、ITO電極には、マイナス電極をつなぎ、室温で、2mm 7 の直流電荷を 2mm 7 分間かけた。その後、2mm 2 2mm 8 SDS、2mm 7 公式 2mm 8 C (2mm 1 2mm 8 SDS、2mm 8 SDS、2mm 8 C (2mm 1 2mm 8 SDS、2mm 8 SDS、2mm 8 C (2mm 2 SDS C 2mm 2 SDS C (2mm 2 SDS C (2mm 2 SDS C 2mm 2 SDS C (2mm 2 SDS C 2mm 2 SDS C (2mm 2 SDS C 2mm 2 SDS C 2mm 2 SDS C 2mm 8 SDS C 2mm 8 SDS C 2mm 9 SDS C 2mm

図7に示す蛍光と反射光とを同時に計測することができるDNAマイクロアレイスキャナーによって、このマイクロアレイを観察した結果、図10に示すように、電荷をかけたもの(c)では、電荷をかけなかったもの(b)に比べ明らかに高い蛍光シグナルが得られ、電気泳動により、ハイブリダイゼーションの促進効果があることが明らかとなった。またこの蛍光像を、反射像(a)と重ね合わ



せれば、ハイブリダイゼーションの生じたスポットを特定することができる。 【0059】

## 実施例4

誘電泳動によるハイブリダイゼーションの促進効果の検証(交流電荷)

実施例1で得られた核酸マイクロアレイ用基板の突出スポット部頂上のスポッ ト用平面に、5種類のDNAプローブ(配列番号3:ggccgttctgcttacagtggcttgcag agcagctcctacttgatg·遺伝子名NFL、配列番号4:gtaccaacattgcctcctagcagagaa gtgtgtgtgtgtgagaagcc·遺伝子名Ubiquitin2e、配列番号5:ttttgtccccccaacttga tgtatgaaggctttggtctccctggg 遺伝子名  $\beta$  -actin、配列番号 6 : gcagtggcaaagtggagattgttgccatcaacgaccccttcattg 遺伝子名gapdh、配列番号 7:agccaggaaatttg tcgagagcgcagccacttctttcagtgttgc 遺伝子名psbP) を末端固定し、5'蛍光Cy3標 識した各相補オリゴDNAをターゲットとしてハイブリダイゼーションを行った 。ハイブリダイゼーション溶液は50mMヒスチジンとし、各相補鎖オリゴDNAの最終 ターゲット濃度を、配列番号3のDNAプローブについては0.001μM、配列番号 4のDNAプローブについては0.01μM、配列番号5のDNAプローブについて は0.1μM、配列番号6のDNAプローブについては1μM、配列番号7のDNAプ ローブについては0μM(無添加)として調製混合した。マイクロアレイと対向金 電極を向かい合うようにし、その間に絶縁のために0.03mmのゴムシートをはさみ 、マイクロアレイと電極とをクリップにより固定した。0.03mmの空間に上記ター ゲットを有するハイブリダイゼーション溶液を入れ、マイクロアレイと対向金電 極とを、電源・発振器につなぎ、1MHz、0.2MV/mの交流電荷を2分間かけた。図 7に示す蛍光と反射光とを同時に計測することができるDNAマイクロアレイス キャナーによって、このマイクロアレイを観察した結果、図11に示すように、 電荷をかけたもの(a)では、電荷をかけなかったもの(b)に比べ明らかに高 い蛍光シグナルが得られた。ターゲット濃度と蛍光強度との相関を、図12に示 す。図11および図12より、マイクロアレイと対向電極との間に交流電荷を印 加することによって、誘電泳動によるハイブリダイゼーションの促進効果が得ら れることがわかる。また、本実施例で、ターゲット濃度に依存した蛍光シグナル が得られていること、および、ネガティブコントロールでシグナルが検出されな



かったことから、蛍光強度により、ハイブリダイゼーションの程度を測定することができることがわかる。また、図11(a)の蛍光像を、図11(c)の反射像と重ね合わせれば、ハイブリダイゼーションの生じたスポットを特定することができる。

#### [0060]

## 【発明の効果】

本発明によれば、生体分子マイクロアレイに一定形状の生体分子固定化領域を持つ基板及び生体分子の相互作用、特にハイブリダイゼーションを高速に行い、かつ微量サンプルの相互作用を促進させ、さらに高速・高感度に相互作用を検出し解析する手段を提供することができる。

## 【配列表】

#### SEQUENCE LISTING

<110> RIKEN

<120> Substrate for biomolecule microarray, biomolecule microarray, device and method for accelerating interaction and detecting method of interaction

<130> A35048H

<160> 7

<210> 1

<211> 45

<212> DNA

<213> GAPDH

<400> 1

tatgacaatg aatacggcta cagcaacagg gtggtggacc tcatg 45

<210> 2

<211> 45

<212> DNA

<213> GAPDH



<400> 2

tatgacaatg aatacggcta cagcaacagg gtggtggacc tcatg 45

<210> 3

<211> 45

<212> DNA

<213> NFL

<400> 3

ggccgttctg cttacagtgg cttgcagagc agctcctact tgatg 45

<210> 4

<211> 45

<212> DNA

<213> Ubiquitin2e

<400> 4

gtaccaacat tgcctcctag cagagaagtg tgtgtgtgag aagcc 45

<210> 5

<211> 45

<212> DNA

 $<213> \beta$ -actin

<400> 5

ttttgtcccc ccaacttgat gtatgaaggc tttggtctcc ctggg 45

<210> 6

<211> 45

<212> DNA

<213> gapdh

<400> 6

gcagtggcaa agtggagatt gttgccatca acgacccctt cattg 45

<210> 7

<211> 45

<212> DNA



<213> psbP

<400> 7

agccaggaaa tttgtcgaga gcgcagccac ttctttcagt gttgc 45

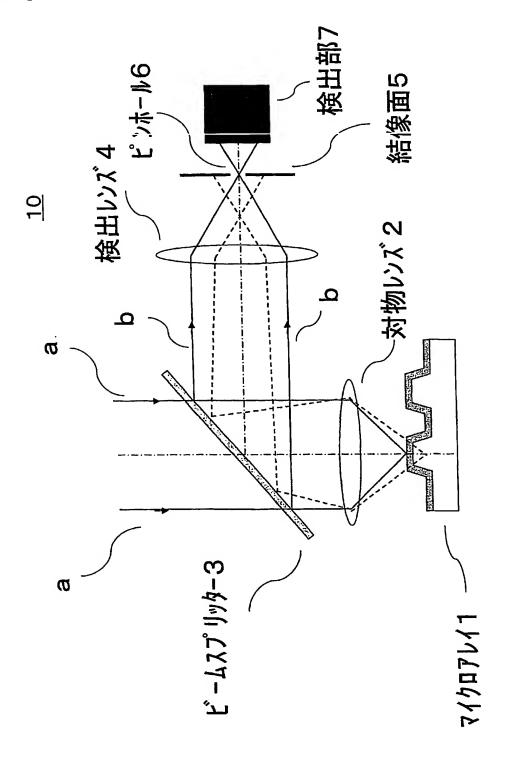
# 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明で使用される共焦点型検出器の光学系の概略図である。
- 【図2】本発明の基板上の突出スポット部の概略図である。
- 【図3】本発明の基板の粗面化されたスポット用平面の一例(部分拡大図)を示す。
  - 【図4】略V字型底面を有する基板の一部の拡大図を示す。
  - 【図5】本発明の第二の態様の基板の一例を示す。
  - 【図6】本発明の生体分子の相互作用促進用装置の概略図を示す。
- 【図7】反射光と蛍光とを同時に検出することができる共焦点型スキャナーの光 学系の概略図を示す。
- 【図8】実施例1で作製した基板のデジタルカメラ像および共焦点顕微鏡像である。
- 【図9】実施例2で得られた蛍光像(a)、反射像(b)、および、蛍光像と反射像とを重ね合わせた像(c)である。
  - 【図10】実施例3で得られた反射像および蛍光像である。
  - 【図11】実施例4で得られた反射像および蛍光像である。
- 【図12】実施例4におけるターゲット濃度と蛍光強度との相関を示すグラフである。



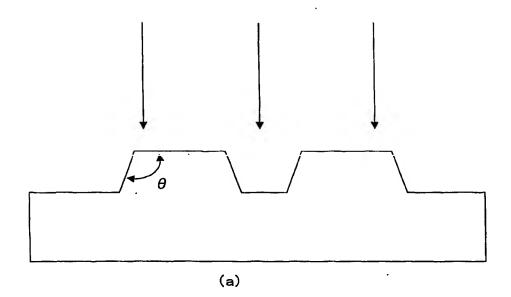
【書類名】 図面

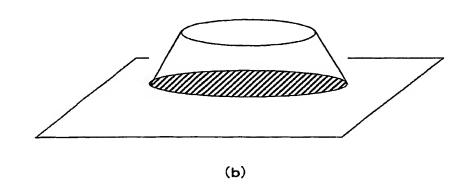
【図1】





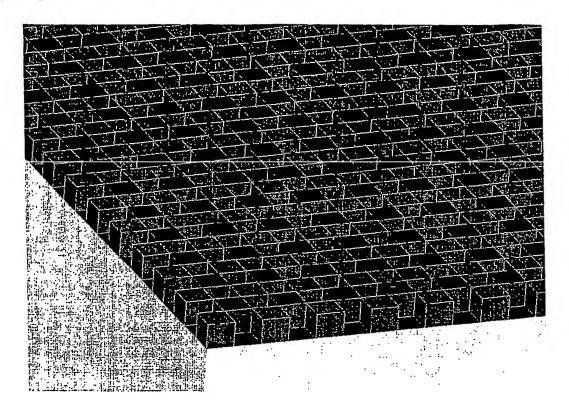
【図2】





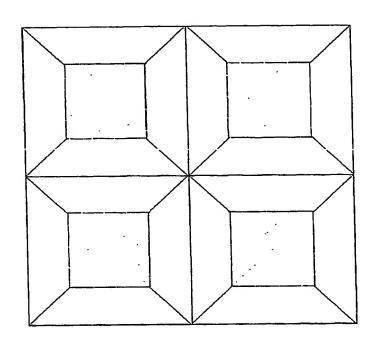


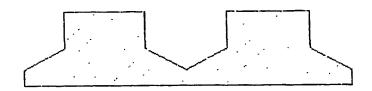
# 【図3】





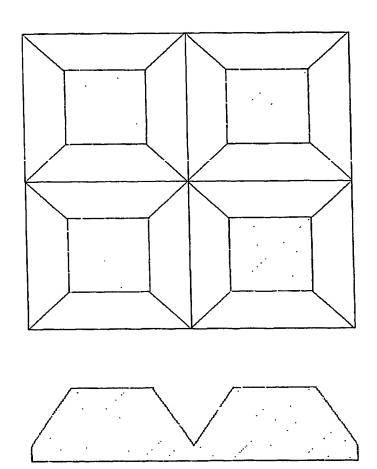
【図4】





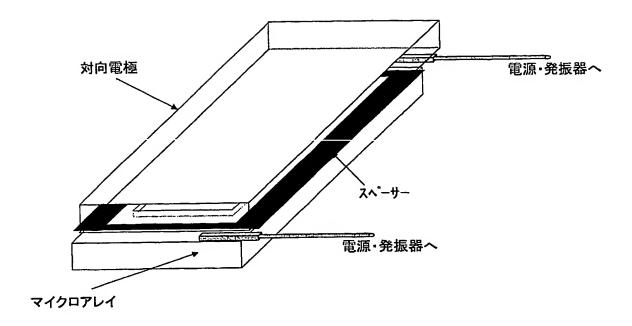


【図5】

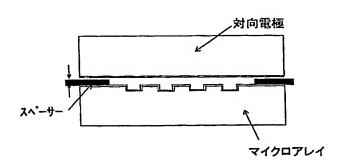




# 【図6】



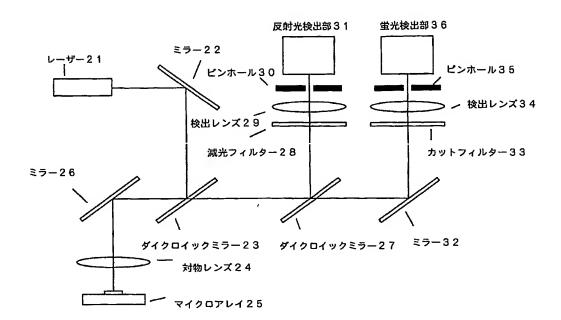
(a)



(b)

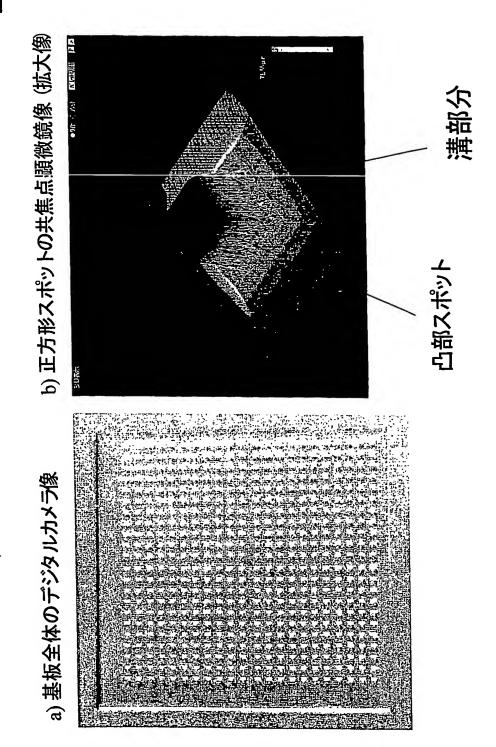


# 【図7】



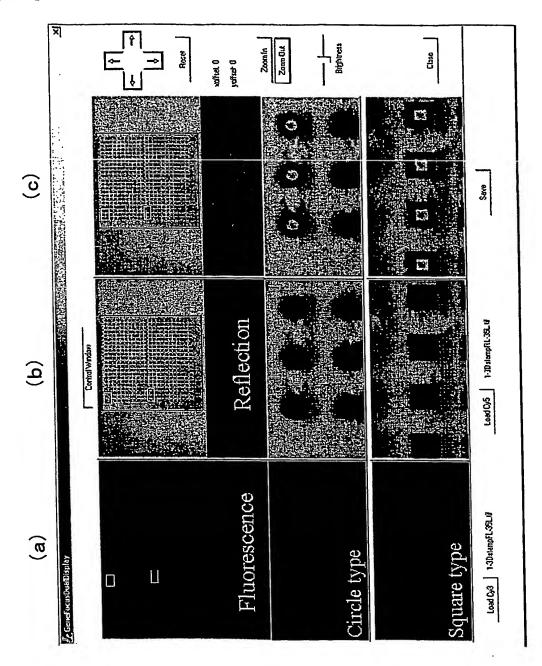


【図8】



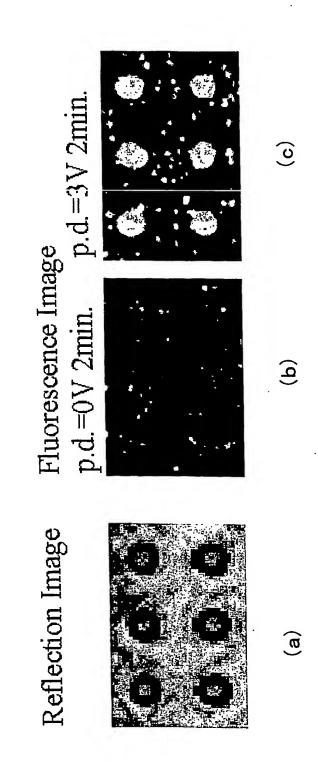


【図9】



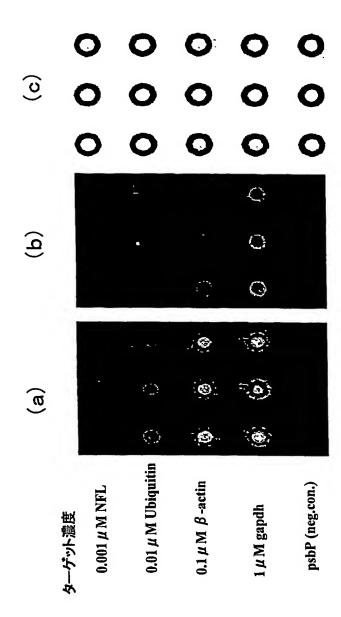


【図10】



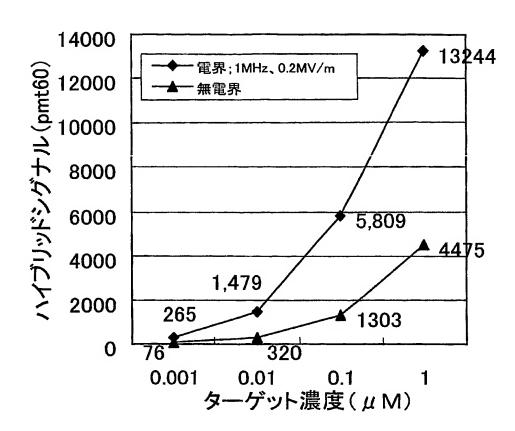


【図11】





【図12】







#### 【書類名】要約書

#### 【要約】

【課題】生体分子マイクロアレイに一定形状の生体分子固定化領域をもつ基板及 び生体分子の相互作用を高速に行い、かつ微量サンプルの相互作用を促進させ、 さらに高速・高感度に相互作用を検出し解析する手段を提供すること。

【解決手段】基板表面に、生体分子固定化用スポットを1つ以上有する生体分子マイクロアレイ用基板。前記生体分子固定化用スポットは、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有し、かつ少なくとも、前記突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およびスポット用平面は、導電性物質からなるか、または、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有し、隣り合う突出スポット部は、突出スポット部側面によって隣接しており、かつ少なくとも、前記突出スポット部側面およびスポット用平面は、導電性物質からなる。前記基板および生体分子を含み、生体分子は、前記基板上の少なくともスポット用平面に固定化されている生体分子マイクロアレイ。基板上に1つ以上の生体分子固定化スポットを有する生体分子マイクロアレイ、前記マイクロアレイの生体分子固定化スポットを有する面に対向するように設けられた電極、および前記マイクロアレイと前記電極との間に電界を印加するための電源を有する生体分子の相互作用促進用装置。前記装置を用いる生体分子の相互作用促進方法。生体分子相互作用の検出方法。

【選択図】なし

1/E



【書類名】 出願人名義変更届(一般承継)

【提出日】平成15年12月 1日【あて先】特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2003-170051

【承継人】

【識別番号】 503359821

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 【氏名又は名称】 独立行政法人理化学研究所

【承継人代理人】

【識別番号】 100075812

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉武 賢次

【提出物件の目録】

【物件名】 権利の承継を証明する書面 1

【援用の表示】 平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

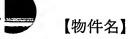
にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】 登記簿謄本 1

【援用の表示】 平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】 委任状 1



委任状

【添付書類】 むら

委 任 状



私は、

識別番号 100075812 弁理士 吉 武 賢 次 氏 を代理人と定めて下記事項を委任する。

9545

- 1. 別紙目録に記載の特許出願に関する出願人名義変更届をする件
- 2. 上記各項の手続を処理するため復代理人を選任及び解任する件

以上

平成 / 5 年 // 月 / 9 日

住所又は居所 埼玉県和光市広沢2番1

氏名又は名称 独立行政法人 理化学研

代表者 理事長野依良



# 目録(1)

1.	特顧昭63-235737	<b>51.</b>	特願平07~327372
2.	特願平05-044143	<b>52.</b>	特願平08-000652
3.	特願平05-127257	<b>53.</b>	特顯平08-026368
4.	特願平05-127258	54.	特願平08-030850
5.	特願平05-213675	55.	特願平08-041279
6.	特願平05-306164	56.	特願平08-045903
7.	特顯平05-328611		
		<b>57.</b>	特顯平08-051604
8.	特願平05-336746	58.	特願平08-065715
9.	特顯平06-035100	бЭ.	特顧平Û8−U70071
10.	特顯平06-061792	<b>60.</b>	特願平08-105667
11.	特願平06一061793	61.	特願平08-107784
12.	特願平06-069150	62.	特願平08-116473
13.	特願平06-097098	63.	特願平08-123475
14.	特願平06-111624	64.	特顯平08-127005
15.	特願平06-121100	65.	特顯平08-131746
16.	特願平06-145908	66.	
17.	特願平06-158670		特願平08-132846
		67.	特顯平08-132854
18.	特願平06-158671	68.	特願平08-142676
19.	特願平06-165751	69.	特顧平08-158078
20.	特顧平06-165752	70.	特願平08-167401
21.	特願平06-181857	71.	特願平08-196331
22.	特願平06-235742	72.	特願平08-197050
23.	特願平06-238603	73.	特願平08-197051
24.	特願平06-244764	74.	特顧平08-211946
25.	特願平06-248486	75.	特願平08-216506
26.	特願平06-252942	76.	特願平08-216508
27.	特額平06-268723	77.	
28.	特顯平06-293933	78.	特願平08-222352
29.			特顯平08-231066
	特顯平06-301372	79.	特顯平08-233442
30.	特願平06-323795	80.	特顯平08-236685
31.	特願平06-324490	81.	特顯平08-251410
32.	特願平06-507966(7462002-13	•	特顯平08-262051
33.	特願平07-007185	83.	特願平08-302896
34.	特願平07-069255	84.	特願平08~308335
35.	特願平07-082880	85.	特願平08-308336
<b>36.</b>	特願平07-083142	86.	特願平08-311467
37.	特願平07-117933	87.	特願平08-315093
38.	特願平07-133487	88.	特顧平08-317622
39.	特顯平07-205141	89.	特願平08-320241
40.	特顯平07-214659	90.	特願平08-506395
41.	特願平07-217276	91.	特願平09-002295
42.	特願平07-236185	92.	特願平0.9-010602
43.	特願平07-240684	93.	特願平09-019968
44.	特願平07-249244	94.	特顧平09-019969
45.	特顯平07-259922	95.	特願平09-019971
46.	特願平07-282716	96.	特願平09-024890
47.	特願平07-302793	97.	特願平09-028982
48.	特願平07-306004	98.	特願平09-046824
49.	特顯平07-311711	99.	特顯平09-049254
50.	特顧平07-311715	100.	技術でもの、 4月 4 4 7 4
50.	AND ALL OIL OILLE	too.	特願平09-053478



# 目録(2)

101.	特願平09-054595	151. 特願平10-045434
102.	特顧平09-056654	152. 特願平10-049499
103.	特願平09-057342	153. 特願平10-049867
104.	特願平09-058774	154. 特願平10-051489
105.	特願平09-067611	155. 特願平10-051490
106.	特願平09-074394	156. 特願平10-051490
107.	特顧平09-080480	157. 特願平10-051491
108.	特願平09-082965	158. 特願平10-051492
109.	特顧平09-091523	159. 特顯平10-080740
110.	特願平09-091591	
111.	特願平09-091694	160. 特願平10-060741 161. 特願平10-061895
112.	特願平09-096988	162. 特顯平10-076139
113.	特願平09-099061	163. 特願平10-076139
114.	特願平09-099109	164. 特願平10-085207
115.	特願平09-104093	165. 特願平10-103083
116.	特願平09-119730	166. 特願平10-103083
117.	特願平09-129068	167. 特顯平10-103118
118.	特願平09-134525	168. 特願平10-104093
119.	特願平09-147964	169. 特顯平10-104093
120.	特顯平09-155364	170. 特願平10-113493
121.	特願平09-159963	171. 特願平10-110378
122.	特願平09-163630	172. 特願平10-127456
123.	特顧平09-163631	173. 特願平10-127320
124.	特願平09-171924	174. 特願平10-149603
125.	特顯平09-175896	175. 特願平10-150494
126.	特顯平09-180423	176. 特顯平10-151245
127.	特願平09-189436	177. 特願平10-155838
128.	特願平09-198201	178. 特願平10-155841
129.	特願平09-208866	179. 特願平10-156104
130.	特願平09-221067	180. 特願平10-156108
131.	特願平09-228345	181. 特願平10-198313
132.	特願平09-230870	182. 特願平10-200280
133.	特願平09-253740	183. 特願平10-217132
134.	特願平09-256795	184. 特願平10-217180
135.	特願平09-271782	185. 特願平10-222837
136.	特願平09-291995	186. 特願平10-227939
137.	特願平09-297084	187. 特願平10-229591
138.	特願平09-307627	188. 特顯平10-232520
139.	特願平09-308597	189. 特願平10-232590
140.	特願平09-309848	190. 特願平10-236009
141.		191. 特願平10-237485
142.	特願平09-327609	192. 特願平10-238144
143.	特願平09-328742	193. 特顧平10-245293
144.	特願平09-360327	194. 特顯平10-250598
145.	特願平10-002030	195. 特願平10-250611
146.	特願平10-010471	196. 特願平10-252128
147.	特願平10-014152	197. 特顯平10-260347
148.		198. 特願平10-260416
149.		199. 特願平10-268791
150.	特願平10-043335	200. 特願平10-269859



# 目録(3)

			48,000
201.	特顧平10-272529		特願平11-135137
202.	特願平10-280351		特顯平11-135482
203.	特願平10-308533	253.	特願平11-143429
204.	特願平10-309765	254.	特願平11-144005
205.	特願平10-311673		特願平11-147097
206.	特願平10-311674		特願平11-151099
207.	特願平10-311675	257.	特顯平11-166247
208.	特願平10-314856		特顯平11-173839
209.	特顯平10-314630 特顯平10-315751		特顯平11-179278
210.	特顧平10-313781		
			特願平11-186052
211.	特顯平10-338897	261.	特願平11-193235
212.	特願平10-338898	262.	特願平11-224269
213.	特顯平10-338899		特願平11-225060
214.	特願平10-352428	264.	特願平11-225832
215.	特願平10-354665	265.	特願平11-225839
216.	特願平10-363297	266.	特願平11-226176
217.	特願平10-363329	267.	特願平11-234800
218.	特願平10-506788	268.	特顯平11-240325
219.	特願平10-532832	269.	特顯平11-24.0910
220.	特願平10-535583	270.	特願平11-241737
221.	特願平11~008183	271.	特願平11-242438
222.	特願平11-013380	272.	特顯平11-242490
223.	特願平11-015176	273.	特願平11-253851
224.	特願平11-031724	274.	特願平11-260947
225.	特願平11-035776 ·	275.	特願平11-277759
226.	特願平11-046372	276.	特顧平11-278976
227.	特願平11-055835	277.	特顧平11-279324
228.	特願平11-055867	278.	特願平11-281632
229.	特願平11-055930	279.	特願平11-303976
230.	特顯平11-056957	280.	特願平11-309616
231.	特顧平11-057381	281.	特願平11-315036
232.	特顯平11-057749	282.	特願平11-321282
233.	特顯平11-058103	283.	特願平11-336079
234.	特願平11-061079	284.	特願平11-346467
235.	特願平11-061080	285.	特願平11-354563
236.	特顯平11-064193	286.	特顯平11-360274
237.	特顯平11~064372	287.	特願平11-365899
238.	特願平11-064506	288.	特顯平11-373483
239.	特願平11-065136	289.	特願平11-510791
240.	特願平11-074385	290.	特願平11-515324
241.		291.	
242.	特願平11-090383	292.	特願2.000-005221
243.	特願平11-091875	293.	特願2000-009363
244.		294.	特顧2000-010516
245.		295.	特顧2:000-011147
246.		296.	特願2000-011147
247.		297.	特願2000-011623
248.		298.	特願2000-016622
249.		299.	
2 <del>4</del> 9. 250.		298. 300.	特願2000-017112
200.	TO U O T T T T POUL	QUU.	特願2000-018612



# 目録(4)

301.	特願2000一019195	351.	特願2000-141763
302.	特願2000~019528	352.	特願2000-148843
303.	特願2000-020067	353.	特願2000-152455
304.	特願2000-030321	354.	特顯2000-152469
305.	特願 2 0 0 0 - 0 3 4 1 0 9		
	- ·	355.	特願2000-154484
306.	特願2000-039082	, 356.	特顧2000-161895
307.	特願2000-040355	357.	特願2000-163122
308.	特願2000-041927	358.	特願2000-164584
309.	特顯2000-041929	359.	特顯2000-179723
310.	特願2000-045318	360.	特願2000-181281
311.	特顧2000-045855	361.	特願2000-184259
312.	特願2000-051488	362.	特願2000-184295
313.	待顧2000-051650	363.	特願2000-191007
314.	特顯2000-052040	364.	特願2000-191265
315.	特顧2000-053707	365.	特願2000-192332
316.	特顧2000-054949		
	12 11 7	366.	特願2000-193817
317.	特願2000-056093	367.	特願2000-195384
318.	特額2000-056879	368.	特願2000-196991
319.	特願2000-057564	369.	特顧2000-197022
320.	特顧2000-057565	370.	特願2000-202801
321.	特顧2000-057566	371.	特顯2000-216457
322.	特顧2000~058133	372.	特願2000-223714
323.	特顧2000-058282	373.	特願2000-224970
324.	特顧2000-062316	374.	特願2000-225486
325.	特顧2000-064142	375.	特顯2000-225864
326.	特顧2000-064209	376.	特顯2000-225978
327.	特顧2000-071119	377.	特願2000-226361
328.	特額2000-076122	378.	特願2000-229191
329.	特顧2000-085874	379.	特願2000-230551
330.	特願2000-089078	380.	特顧2000-237165
331.	特願2000-092693	381.	特顯2000-237166
332.	特顧2000-100395	382.	特願2000-237533
333.	特願2000-105139	383.	特願2000-246309
334.	特顧2000-105917	384.	
335.	特顧2000-103917	385.	特願2000-248331 特願2000-248331
336.	特顧2000-108409	386.	特顯2000-249232
337.	特顧2000-100408		特願2000-256149
338.	特願2000-109056	387. 388.	特顧2000-257080
339.			特顯2000-257083
	特願2000-118361	389.	特願2000-260030
340.	特願2000-120874	390.	特願2000-261233
341.		391.	特願2000-264743
342.		392.	特顧2000-265344
343.		393.	特願2000-278502
344.		394.	特顧2000-279557
345.		395.	特願2000-292422
346.		396.	特顯2000-292832
347.	* * ** **	397.	特願2000-299812
348.		398.	特願2000-307464
349.		399.	特願2000-308248
350.	特願2000-141566	400.	



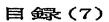
# 目録(5)

401	## KE 9 0 0 0 - 0 1 0 7 7 F	ATA AMERICANA ARTHUR
401.	特願2000-319775	451. 特願2001-071435
402.	特願2000-322056	452. 特顧2001-072650
403.	特願2000-333311	453. 特顧2001-072668
404.	特顧2000-334686	454. 特願2001-072963
405.	特願2000-334969	455. 特願2001-073028
406.	特願2000-343912	456. 特願2001~074964
407.	特願2000-347398	457. 特願2001-074965
408.	特願2000-347865	458. 特顧2001-077257
409.	特顧2000-358121	459. 符麒2001-078671
410.	特願2000-368566	460. 特願2001-084173
411.	特願2000-374626	461. 特願2001-089541
412.	特願2000-375090	462. 特願2001-091911
413.	特顧2000-378421	463. 特願2001-092337
414.	特願2000-378942	464. 特願2001-116171
415.	特願2000-378950	465. 特願2001-124294
416.	特願2000-384771	466. 特願2001-124294
417.	特願2000-387016	467. 特願2001-127575
418.	特願2000-394815	
419.	特願2000-396445	
420.	特願2000-399940	
421.	特顯2000-3000-40	
422.	特願2000-401110	471. 特願2001-138103
422. 423.		472. 特願2001-142583
423. 424.	特願2000-401245	473. 特願2001-147081
	特願2000-401258	474. 特願2001-152364
425.	特願2000-503838	475. 特願2001-152379
426.	特願2000-571733	476. 特顧2001-153447
427.	特願2000-571943	477. 特願2001-155572
428.	特願2000-602588	478. 特願2001-163740
429.	特顯2000-602900	479. 特願2001-164819
430.	特顧2000-618709	480. 特願2001-164997
431.	特顯2001-003476	481. 特顧2001-165133
432.	特顧2001-005615	482. 特願2001-167910
433.	特願2001-007979	483. 特願2001-168784
434.	特願2001-016626	484. 特願2001-171705
435.	特顧2001-025030	485. 特顧2001-173331
436.	特願2001-037141	486. 特願2001-174421
437.	特願2001-037147	487. 特願2001-174553
438.	特願2001-042501	488. 特顧2001-175898
439.		489. 特願2001-178169
440.	特願2001-047762	490. 特顧2001-179858
441.		491. 特願2001-180552
442.		492. 特願2001-180554
443.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	493. 特願2001-187735
444.		494. 特願2001-197185
445.		495. 特願2001-197897
446.		496. 特願2001-200854
447.		497. 特願2001-201356
448.		498. 特顧2001-202971
449.	· ·	499. 特願2001-203089
450.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	500. 特願2001-206505
		0001 14 mg 2 0 0 1 - 2 0 0 0 0 0 0



# 目録(6)

501.	特願2001-206522	551. 特顧2001-325367
502.	特願2001-206523	552. 特願2001-326872
503.	特願2001-209305	553. 特願2001-327853
504.	特願2001-212947	554. 特願2001-329023
505.	特願2001-216505	555. 特顧2001-332168
506.	<b>特願2001-220219</b>	556. 特顧2001-337467
507.	特顧2001-226176	557. 特顧2001-339396
508.	特顧2001-228287	558. 特顯2001-339593
509.	<b>特顧2001-228374</b>	559. 特顯2001-346035
510.	特顧2001-235412	560. 特顯2001-347316
511.	特願2001-235747	561. 特顧2001-347637
512.	特顧2001-238951	562. 特顧2001-349614
513.	特顧2001-241023	563. 特願2001-351730
514.	特顧2001-243930	584. 特顧2001-352189
515.	特願2001-246642	565. 特願2001-353038
516.	特願2001-249976	566. 特顯2001-358446
517.	特願2001-254377	567. 特願2001-358581
518.	特願2001-254378	568. 特願2001-359710
519.	特願2001-255589	569. 特顧2001-374928
520.	特願2001-256576	570. 特顧2001-376591
521.	特顧2001-257188	571. 特願2001-378757
<b>522.</b>	特願2001-261158	572. 特顯2001-380473
523.	特願2001-266004	573. 特願2001-382537
524.	特願2001-266069	574. 特願2001-382539
<b>525.</b>	特願2001-266454	575. 特顯2001-382599
<b>526.</b>	待顧2001-267194	576. 特願2001-385258
<b>527.</b>	特願2001-267379	577. 特願2001-385512
528.	特顧2001-267863	578. 特顯2001-385513
<b>529.</b>	特願2001-272977	579. 特願2001-385538
530.	特願2001-273964	580. 特顯2001-388116
531.	特願2001-276053	581. 特顧2001-390122
532.	特顧2001-279406	582. 特顧2001-392087
533.	特願2001-280319	583. 特願2001-392088
534.	特顯2001-285145	584. 特願2001-395196
535.	特顯2001-291059	585. 特願2001-396120
536.	特願2001-292223	586. 特願2001-397762
537.	特願2001-292224	587. 特願2001-397998
538 <b>.</b>	特願2001-293000	588. 特願2001-401139
539. 540.	特顯2001-293054	589. 特願2001-515803
	特願2001-293936	590. 特顧2001-523852
541.	特願2001-294013	591. 特顧2001-557672
542.	特願2001-298140	592. 特顧2002-000993
543.	特願2001-298402	593. 特顧2002-005746
544.	特願2001-307340	594. 特顧2002-010344
545.	特願2001-309501	595. 特願2002-011558
546.	特願2001-309508	596. 特額2002-019752
547.	特願2001-309984	597. 特願2002-020329
548.	特願2001-310554	598. 特顧2002-022499
5 <b>49</b> .	特顧2001-313430	599. 特願2002-028046
550.	特願2001-319360	600. 特顧2002-028109



601.	特願2002-040151	651.	特顧2002-162157
602.	特願2002-042829	652.	特願2002-162211
603.	待顧2002-044340	653.	特額2002-162365
604.	特願2002-044640	654.	特顧2002-167759
605.	特顧2002-046188	655.	特願2002-170068
606.	特願2002-047799	656.	特願2002-170902
607.	特願2002-053190	657.	特願2002-176435
608.	特願2002-053575	658.	特願2002-176583
609.	特願2002-055272	659.	特願2002-183722
610.	特願2002-057253	660.	特願2002-185966
611.	特願2002-057565	661.	<b>特願2002-187362</b>
612.	特願2002-057935	662.	特願2002-187957
613.	特願2002-057963	663.	特願2002-188281
614.	特願2002-066249	664.	特願2002-189265
615.	特願2002-070624	665.	特願2002-194627
616.	特願2002-070987	666.	特願2002-197812
617.	特顧2002-071924	667.	特願2002-201443
618.	特願2002-074902	668.	特願2002-201575
619.	特願2002-078164	669.	特顧2002-202118
<b>620.</b>	特願2002-081467	670.	特願2002-205814
621.	特願2002-081502	671.	特願2002-205825
622.	特願2002-083081	672.	特願2002-217714
623.	特願2002-084139	673.	特願2002-221188
624.	特願2002-085017	674.	特願2002-225469
625.	特願2002-087342	675.	特顯2002-225724
626.	特顯2002-094681	676.	特顧2002-226859
627.	特願2002-095132	677.	特願2002-227286
628.	特願2002-095389	678.	特願2002-229686
629.	特願2002-100431	679.	特願2002-230562
630.	特願2002-106561	680.	特顧2002-235294
631.	特願2002-119320	681.	特顯2002-235737
632.		682.	特顧2002-236838
633.		683.	特顯2002-237058
634. 635.		684.	特願2002-237092
636.		685. 686.	特願2002-248946 特顧2002-253322
637.		687.	特願2002-253322
638.		688.	特願2002-253697
639.		689.	特願2002-253097
640.		690.	特願2002-257924
641.		691.	
642.		692.	特願2002-261499
643.		693.	特願2002-264969
644.		694.	特願2002-267114
645.		695.	特願2002-268987
646.	*	696.	特願2002-270917
647.		697.	特顧2002-270917
648.		698.	特願2002-271373
649.		699.	特願2002-271473
650.		700.	特願2002-274469
000		100.	13 KK L U U L — 4 1 4 4 U S



# 目録(8)

701.	特願2002-276051	751. 特願2003-012738
702.	特願2002-282746	
703.	特顧2002-286487	752. 特顧2003-012774
		753. 特願2003-015968
704.	特願2002-289209	754. 特願2003-016044
705.	特願2002-295332	755. 特願2003-016940
706.	特願2002-296911	756. 特顧2003-017397
707.	特願2002-299429	757. 特願2003-021499
708.	特願2002-301875	758. 特顧2003-024347
709.	特願2002-303838	759. 特顧2003-024620
710.	特願2002-312131	760. 特顧2003-025277
711.	特願2002-320102	761. 特願2003-027647
712.	特願2002-320704	762. 特願2003-027648
713.	特願2002-325909	763. 特願2003-031882
714.	特願2002-325920	764. 特顧2003-032932
715.	特願2002-332232	765. 特願2003-038206
716.	特願2002-339344	766. 特顧2003-040642
717.	特願2002-339392	767. 特願2003-043961
718.	特願2002-339541	768. 特願2003-043981
719.	特願2002-339551	769. 特顧2003-050183
720.	特願2002-341195	770. 特顧2003-052520
721.	特願2002-343807	771. 特顧2003-052602
722.	特願2002-344279	772. 特顧2003-052602
723.	特顧2002-345597	773. 特顧2003-052813
724.	特願2002-347401	
725.	特顯2002-348760	
726.	特願2002-349042	
727.	特願2002-354594	
728.	特顯2002-357768	
729.	特願2002—357900	778. 特願2003-054846
730.	特願2002—358019	779. 特願2003-054847
731.	特願2002-358967	780. 特願2003-054848
732.	特顯2002—360972	781. 特願2003-054849
733.	特願2002—360972	782. 特願2003-055452
734.	特願2002-368112	783. 特願2003-056628
735.	特顧2002-376555	784. 特願2003-061426
736.	特願2002-376774	785. 特願2003-063532
737.	特顯2002—376月74	786. 特顧2003-065013
738.		787. 特願2003-071028
739.	特願2002-379214	788. 特顧2003-072979
740.	特願2002-380624	789. 特願2003-074168
	特願2002-381888	790. 特顧2003-076107
741.	特願2002-382170	791. 特顧2003-078999
742.	特願2002-383870	792. 特額2003-079598
743.	特願2002-521844	793. 特顯20,03-079613
744.	特願2002-532458	794. 特願2003-082466
745.	特願2002-548584	795. 特顧2003-083318
746.	特顧2002-548185	796. 特願2003-083433
747.	特願2002-570743	797. 特願2003-083480
748.	特顧2003-003450	798. 特顧2003-085193
749.	特願2003-012550	799. 特願2003-089026
750.	特顧2003-012694	800. 特願2003-090331
		14W/= 0 0 0 0 0 0 T



## 目録(9)

801.	特願2003-091446	851. 待願2003-127135
802.	特願2003-092654	852. 特願2003-127150
803.	特願2003-093642	853. 待願2003-128818
804.	特願2003-094272	854. 特願2003-128897
805.	特願2003-094719	855. 特願2003-129347
806.	特願2003-095770	856. 特願2003-131313
807.	特願2003-095884	857. 特顧2003-132280
808.	特願2003-095885	858. 特願2003-132605
809.	特願2003-095886	859. 特願2003-132606
810.	特願2003-095904	860. 特願2003-135591
811.	特願2003-097283	861. 特願2003-138445
812.	特願2003-097327	862. 特願2003-139397
813.	特願2003-101917	863. 特願2003-140684
814.	特願2003-104928	864. 特願2003-142303
815.	特願2003-105362	865. 特願2003-143932
816.	特願2003-107267	866. 特願2003-145221
817.	特願2003-107268	867. 特顧2003-145390
818.	特願2003-107647	868. 特願2003-147820
819.	特願2003-107885	869. 特顧2003-150690
820.	特願2003-109575	870. 特顧2003-153014
821.	特顧2003-115750	871. 特顧2003~153015
822.	特願2003-115793	872. 特顧2003-153016
823.	特願2003-115847	873. 特顧2003-153985
824.	特願2003-115888	874. 特顧2003-154009
825.	特願2003-116232	875. 特顧2003-154841
826.	特顯2003-116895	876. 特顧2003-155397
827.	特願2003-118161	877. 特顧2003-155407
828.	特願2003-118186	878. 特願2003-158017
829.	特願2003-119749	879. 特願2003-161005
830.	特願2003-119930	880. 特願2003-164126
831.	特願2003-120934	881. 特願2003-170051
832.	特願2003-121233	882. 特顧2003-170324
833.		883. 特願2003-170325
834.		884. 特願2003-170326
835.		885. 特願2003-170327
836.		886. 特願2003-170328
837.		887. 特願2003-170329 888. 特願2003-170330
838.		888. 特願2003-170330 889. 特願2003-170573
839.		890. 特顯2003-170373
840.		891. 特顧2003-171619
841.		892. 特顧2003-171819
842.		893. 特顧2003-172898
843.		894. 特顯2.003-177298
844.		895. 特頭2003-180198
845		896. 特願2003-180198
846		897. 特顧2003-182958
847		898. 特願2003-192763
848 849		899. 特願2003-192775
		900. 特願2003-194837
850	. TOTAL COOP I CIT SO	300. TTMR 2003 - 19 (229



```
特願2003-198340
902.
   特願2003-204075
903.
   特願2003-205349
904.
   特願2003-205710
905.
   特願2003-206546
906.
   特願2003-207698
907.
   特願2003-207771
908.
   特願2003-207772
909.
   特願2003-207850
910.
   特願2003-270049
911.
   特願2003-271473
912.
   特願2003-272421
913.
   特願2003-275055
914.
   特顧2003-277958
   特願2003-279130
915.
   特願2003-283972
916.
917.
    特願2003-284055
918.
   特願2003-286640
919.
   特願2003-289138
920.
    特願2003-293912
    特願2003-296474
921.
    特願2003-298558
922.
923.
    特願2003-299424
924.
    特願2003-303979
925.
    特願2003-304452
926.
    特願2003-304453
927.
    特願2003-305689
    特顧2003-305844
928.
929.
    特願2003-306137
930.
    特願2003-307564
    特額2003-313014
931.
    特願2003-315355
932.
933.
    特願2003-318801
934.
    特顯2003-321497
935.
    特顯2003-322948
936.
    特顧2003-324974
937.
    特願2003-326510
938.
    特顯2003-327645
    特願2003-327907
939.
940.
    特顯2003-328600
941.
    特顯2003-328840
942.
    特願2003-330418
943.
    特願2003-330569
    特願2003-331848
944.
    特顯2003-332756
945.
946.
    特願2003-333798
 947.
    特願2003-333932
    特願2003-334036
 948.
 949.
    特顯2003-334083
    特願2003-336365
 950.
```

951. 特願 2 0 0 3 — 3 3 8 1 9 1 952. 特願 2 0 0 3 — 3 3 9 5 4 2 953. 特願 2 0 0 3 — 3 4 0 1 8 1 954. 特願 2 0 0 3 — 3 4 2 5 1 9





## 認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-170051

受付番号 20308550874

書類名 出願人名義変更届 (一般承継)

担当官 塩野 実 2151

作成日 平成16年 3月17日

<認定情報・付加情報>

【提出された物件の記事】

【提出物件名】 委任状(代理権を証明する書面) 1

## 出願人履歴情報

識別番号

[000006792]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

 埼玉県和光市広沢2番1号

理化学研究所

特願2003-170051

## 出願人履歴情報

識別番号

[503359821]

1. 変更年月日 [変更理由]

2003年10月 1日 新規登録

住所氏名

埼玉県和光市広沢2番1号 独立行政法人理化学研究所

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.